


Staff Scientist 양성프로그램 교육수행계획서(요약본)

1. 교육 개요

과정명	첨단 신소재 TEM 전문가 양성과정(L2)	대상 장비	모델	JEM-2100F/CS Tallos F200X
교육 기간	20주 (80시간)			
교육 목적	투과전자현미경 장비의 원리를 심도깊게 이해하며, 전문적인 장비 기능을 습득하고 활용하여 실무 운용 능력을 단계적으로 향상시키는데 있다.			
목표 수준	특정시료/특화분석 가능 시료에 따른 응용분석 가능			
교육 형태	장비 이론, 장비 운용법, 장비 실습, 측정 결과 분석			

2. 교육 일정 및 내용

교육 주차	연구장비 교육내용	교육 주차	연구장비 교육내용
1주차	장비사용법 교육 및 실습(JEM-2100/CS)	11주차	울트라마이크로톰 시편 제작 실습
2주차	장비사용법 교육 및 실습(Talos F200X)	12주차	Aztec & Velox Software 기반 EDS 분석
3주차	Probe CS-corrector 빔 정렬	13주차	Plasma Cleaner 활용 TEM 시편 처리 실습
4주차	Probe CS-corrector 빔 정렬	14주차	TEM 시편준비 실습
5주차	TEM 영상 이미지 및 전자빔 회절 실습	15주차	결정학 이론
6주차	CS-corrector 활용한 STEM 측정 실습	16주차	결정학 소프트웨어 활용 분석
7주차	CS-corrector 활용한 STEM 측정 실습	17주차	TEM 시편 측정 숙련도 향상 실습
8주차	EDS 심화 교육 및 측정 실습	18주차	TEM 시편 측정 숙련도 향상 실습
9주차	DM 소프트웨어 기반 데이터 편집	19주차	TEM 시편 측정 숙련도 향상 실습
10주차	울트라마이크로톰 시편 제작 실습	20주차	TEM 시편 측정 숙련도 향상 실습